

2019年1月4日

東京大学生産技術研究所 助教公募

下記の要領にて助教の公募をいたします。

記

1. 公募対象： 助教1名
2. 勤務形態： 常勤（正職員）
3. 所 属： 東京大学生産技術研究所 情報・エレクトロニクス系部門 平川研究室
4. 業務内容： ナノエレクトロニクス分野の研究。大学院生の指導および研究室の運営補助
5. 着任時期： 2019年6月1日以降なるべく早い時期。詳細については、相談の上、決定。
※試用期間あり（6か月）
6. 応募資格：
 - 1) 必須条件
 - (1-1) 博士号取得者または着任までに取得見込みの者
 - (1-2) 固体物性、半導体デバイスの実験に関する経験
 - 2) 望ましい条件
 - 特に、以下のいずれかの経験があるとなお良い
 - (2-1) 半導体微細加工プロセス
 - (2-2) 精密電気伝導測定
 - (2-3) 液体ヘリウム温度などでの低温実験
7. 給 与： 本学の規定に基づき支給。扶養手当、住居手当、通勤手当は、本学の支給要件を満たす場合に支給。
8. 就 業 日： 週5日勤務（月～金）
※土日、祝日法に基づく休日、年末年始（12月29日～1月3日）は休日
9. 就業時間等： 専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分、週38時間45分勤務したものとみなされます。
10. 社会保険等： 共済組合、雇用保険、労災保険については法令の定めるところにより加入
11. 応募方法： 本公募に応募予定の方は、まず、下記の間合せ先に電子メールにてご連絡下さい。
提出書類等、応募の詳細について、ご説明をさせていただきます。

- 1 2. 応募書類： (1)履歴書、(2)これまで行ってきた研究の概要 (A4 用紙 2 枚程度)、(3)業績リスト、(4)主要論文の別刷り (3 編程度)、(5)意見を尋ねることの出来る参考人 2 名の氏名と連絡先
- 1 3. 応募期限： 2019 年 3 月 15 日 (金) 必着
(ただし、適任者が見つかりしだい、締め切ることがあります)
- 1 4. 選考方法： 書類による第 1 次選考を実施後、面接等による第 2 次選考を行う。面接に必要な旅費、滞在費等は応募者の負担とする。
- 1 5. 問合せ先： 〒153-8505 東京都目黒区駒場 4-6-1
東京大学 生産技術研究所 平川一彦
e-mail: hirakawa@iis.u-tokyo.ac.jp
- 1 6. 書類送付先： 同上 (封筒に「助教応募書類在中」と朱書きのこと)
ただし、送付する前に、まずは「1 1. 応募方法」のとおり、上記問合せ先に電子メールにてご連絡ください。
- 1 7. その他：
・ 応募の秘密は厳守し、応募書類は採用選考の目的以外には使用いたしません。
・ 応募書類は返却いたしません。

以上